○第 26 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　調達件名及び数量　極低温ＩＣＰエッチング装置　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　納入期限　令和９年６月30日
⑸　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
⑹　第25号に同じ。
⑺　第25号に同じ。
2　競争参加資格
⑴　第25号に同じ。
⑵　第25号に同じ。
⑶　第25号に同じ。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　財務部門調達室　岩本　渚　電話029―859―2655
⑵　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。入札情報公開システム
https://www.nims.go.jp/procurance/PPI.html
ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。
パスワード請求先：password@ml.nims.go.jp
メール件名：W2026007933
⑶　入札説明会の日時及び場所　令和８年10月５日13時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
⑷　証明書等の受領期限　令和８年11月２日15時00分
⑸　入札書の受領期限　令和８年11月17日15時00分
⑹　開札の日時及び場所　令和８年11月18日10時30分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第25号に同じ。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Yoshinori Ito, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Cryogenic ICP Etching System 1 set
⑷　Delivery period : 30, June, 2027
⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　The same as the notice No.25
B　The same as the notice No.25
C　The same as the notice No.25
⑺　Time-limit of tender : 3 : 00 PM, 2, November, 2026
⑻　Contact point for the notice : Procurement Office, Finance Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305―0047 Japan Nagisa IWAMOTO, TEL 029―859―2655
E-mail : password@ml.nims.go.jp, with subject title : W2026007933
⑼　The same as the notice No.25

○第 27 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　調達件名及び数量　自動搬送機能付き塩素系・フッ素系ガス対応ＩＣＰエッチング装置　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　納入期限　令和９年６月30日
⑸　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
⑹　第25号に同じ。
⑺　第25号に同じ。
2　競争参加資格
⑴　第25号に同じ。
⑵　第25号に同じ。
⑶　第25号に同じ。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　財務部門調達室　小田部宜子　電話029―859―2097
⑵　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。入札情報公開システム
https://www.nims.go.jp/procurance/PPI.html
ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。
パスワード請求先：password@ml.nims.go.jp
メール件名：W2026009325
⑶　入札説明会の日時及び場所　令和８年10月５日13時30分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
⑷　証明書等の受領期限　令和８年11月２日15時00分
⑸　入札書の受領期限　令和８年11月17日15時00分
⑹　開札の日時及び場所　令和８年11月18日11時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第25号に同じ。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Yoshinori Ito, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
⑵　Classification of the products to be procured : 24
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Chlorine and Fluorine Gas-Compatible ICP Etching System with Automatic Transfer Function 1 set
⑷　Delivery period : 30, June, 2027
⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　The same as the notice No.25
B　The same as the notice No.25
C　The same as the notice No.25
⑺　Time-limit of tender : 3 : 00 PM, 2, November, 2026
⑻　Contact point for the notice : Procurement Office, Finance Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305―0047 Japan Noriko OTABE, TEL 029―859―2097
E-mail : password@ml.nims.go.jp, with subject title : W2026009325
⑼　The same as the notice No.25

○第 28 号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　調達件名及び数量　３チャンバークラスター式プラズマＣＶＤ装置　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　納入期限　令和９年６月30日
⑸　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
⑹　第25号に同じ。
⑺　第25号に同じ。
2　競争参加資格
⑴　第25号に同じ。
⑵　第25号に同じ。
⑶　第25号に同じ。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　財務部門調達室　小田部宜子　電話029―859―2097